МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 (3) "ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ"

"МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ"

Выполнили:	Лесниченко Александр Олегович (группа 0308)
	Косневич Давид Андреевич (группа 0308)
	Сабурова Елизавета Алексеевна (группа 0308)
Преподаватель:	Анастасия Дмитриевна

Санкт-Петербург 2022

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

К основным метрологическими характеристиками ЦИП относятся: статическая характеристика преобразования, шаг квантования (квант) или единица младшего разряда, основная инструментальная погрешность.

Статическая характеристика преобразования устанавливает связь между преобразуемой входной величиной x и результатом преобразования x_Π (показаниями ЦИП), который может принимать только квантованные значения $x_\Pi = N \cdot q$, где N — десятичное целое число, q — шаг квантования (квант) величины x. В этом отличие ЦИП от аналоговых средств измерений. Отсюда следует ступенчатая форма представления статической характеристики преобразования.

Статическая характеристика

преобразования идеального ЦИП (рисунок 1) получается при квантовании измеряемой величины путем отождествления её с ближайшим по значению уровнем квантования. Изменения показаний идеального ЦИП $x_{\Pi} = N \cdot q$ на единицу младшего разряда q происходят при фиксированных значениях входной величины, равных $(N-0.5) \cdot q$, $N \in \mathbb{N}$.

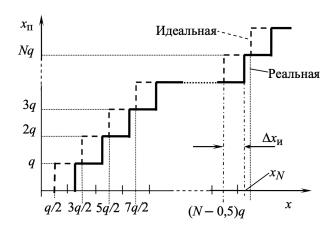


Рис. 1

Статическая характеристика преобразования идеального ЦИП определяется значением единицы младшего разряда показаний, равным кванту q.

Значение кванта q для идеального ЦИП:

$$q = \frac{x_{max}}{N_{max}} \quad (1);$$

Статическая характеристика преобразования реального ЦИП отличается от статической характеристики идеального. Различие проявляется в том, что смена показаний реального ЦИП происходит при значениях входной величины N, отличных от значений $(N-0.5) \cdot q$.

Абсолютная основная погрешность ЦИП равна:

$$\Delta x = x_{\Pi} - x \quad (2);$$

где x_{Π} – показание ЦИП, x – действительное значение измеряемой величины.

Абсолютная инструментальная погрешность определяется для конкретных показаний ЦИП $x_{\Pi} = N \cdot q$ (рисунок 2) по отличию реальной характеристики ЦИП от идеальной:

$$\Delta x = x_{\Pi} - 0.5 \cdot q - x_{N} \quad (3);$$

где x_N - значение входной величины, при котором происходит смена показаний x_Π ЦИП (показания меняются на единицу младшего разряда).

Статическая характеристика преобразования ЦИП определяется в режиме омметра; для этого:

- 1. На вход ЦИП необходимо подключить магазин сопротивлений. Предел измерения ЦИП выбрать по указанию преподавателя, определить для этого предела значение единицы младшего разряда.
- 2. Определить единицу младшего разряда магазина $q_{\rm M}$, проверить выполнение условия $q>>q_{\rm M}$, при этом условии можно пренебречь дискретным характером изменения сопротивления магазина.

Для определения начального участка статической характеристики (рисунок 1) необходимо установить нулевое значение сопротивления магазина R, затем при плавном изменении сопротивления магазина (менять сопротивление магазина с минимально возможным шагом) следить за изменением показаний, фиксируя при этом конкретные значения сопротивления магазина R, при которых показания ЦИП R_{Π} меняются на единицу младшего разряда.

Абсолютную инструментальную погрешность определяют для 8...10 точек, *равномерно распределенных* по выбранному диапазону измерений. Инструментальная погрешность определяется по формуле (3), при этом R_N – значение сопротивления магазина, при котором происходит смена показаний R_Π ЦИП на единицу младшего разряда в выбранной точке.

Определение аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности.

В зависимости от характера изменения по диапазону измерения погрешности делятся на аддитивные и мультипликативные.

- Аддитивные погрешности не зависят от значения измеряемой величины х.
- Мультипликативные растут с увеличением x. Обычно для ЦИП погрешность задается в виде модели $\Delta x = a + bx$, где a, bx аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности соответственно.

Спецификация средств измерений, применяемых при эксперименте

Наименование	Диапазоны измерений	Классы точности	Рабочий диапазон частот	Параметры входа
Вольтметр универсальный цифровой GDM-8135	200[MB], 2[B] 20[B], 200[B]	110111	-	$I_R < 1 [\mathrm{MA}]$ $I_R < 0.01 [\mathrm{MKA}]$
Магазин сопротивлений Р33	0.1,,99999.9[Ом]	0.05	-	-

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

Измерение сопротивлений

Номер	Номер резистора	Диапазон измерения	Значение кванта, [Ом]	Показания ЦИП <i>R</i> п, [кОм]	Абсолютная погрешность измерения ΔR , [кОм]	Относительная погрешность измерения, %	Результат измерения $R_{\Pi} \pm \Delta R$, [кОм]
1	1	200 Ou	馬田	0,1162			
2	1	2 x Ou	10	0,115			
3	1	200 Ou	100	0,99	PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	
4	1	200 x 00	1000	0,2			
5	1	2000 kay	10000	0	anamatan manaman mana		
6	1	DMOvu	1000000	0			
7	2	1000a	1	-	ACTION MINISTER STREET BEST IN		
8	2	2 m O a	10	0,905			
9	2	20104	100	0,9	ALLE MANAGEMENT MANAGEMENT (NO. 12)		
10	2	200 x 0a	1000	1			
11	2	Loova	10,000	0	THE OWNER OF THE OWNER		
12	2	200000	100,000	0			
13	3	200 ou	7			THE STATE OF	
14	3	2 u Oue	10	-			
15	3	20 u ou	100	8,17	The second secon		
16	3	200 u Ou	1000	8,2			
15	3	2 u Om	10.000	8			
18	3	Lo nou	100.000	0			

Rochebur D.A.
Casypola E.A.
Necheirenno 4.0.

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ

Статическая характеристика

Номер измерения	R_{Π} , $[O_{M}]$	R, [[OM]	ΔR , (OM)	
1	0,0,01	0,0012		
2	0,002	20022		
3	0.003	0,00326		
4	0,004	000425		
5	0,005	0.00527		
6	0,006	2,00828		
7	0,00%	0 00424		
8	9,008	900833		
9	9,009.	0 00931		

Таблица 1

Абсолютная инструментальная погрешность

Номер измерения	$R_{\Pi N}$, [ROM]	$R_N, f[OM]$	$\Delta R_{\rm MN}$, [kOm]
1	0,2	0,2013	The state of the s
2	0,4	0,40115	
3	96	0,60103	
4	0,8	0,8 0096	
5	¢,0	1,00089	
6	1,1	1,20099	
7	1,4	1,40005	
8	1,6	1,60132	
9	1,8	1,80181	
te	2,0		

Таблица 2

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Статическая характеристика

Номер измерения	R_{Π} , [кОм]	<i>R</i> , [кОм]	ΔR , [кОм]
1	0.001	0.0012	-0.0002
2	0.002	0.0022	-0.0002
3	0.003	0.00326	-0.00026
4	0.004	0.00425	-0.00025
5	0.005	0.00527	-0.00027
6	0.006	0.00626	-0.00026
7	0.007	0.00724	-0.00024
8	0.008	0.00833	-0.00033
9	0.009	0.00931	-0.00031

Таблица 1

Статическая характеристика преобразования идеального ЦИП и абсолютная инструментальная погрешность измерений:

$$\Delta R = R_{\Pi} - R = 0.001 - 0.0012 = -0.0002;$$

По полученным значениям построим начальный участок графика статической характеристики ЦИП в режиме омметра: $R_{\Pi} = F(R)$:

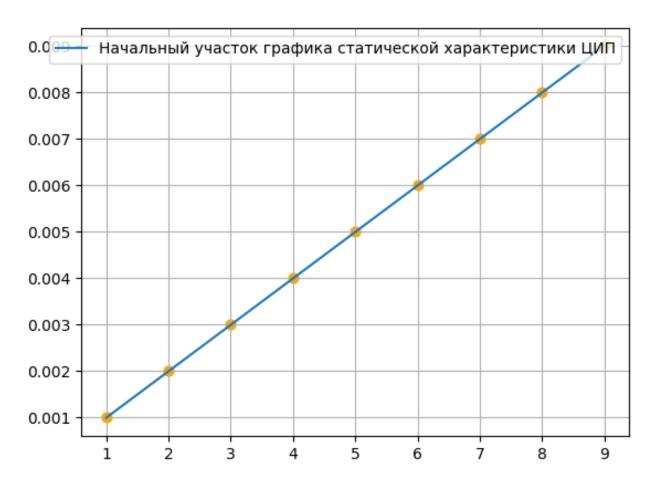


Рис. 1

Также построим график **абсолютной основной погрешности** $\Delta R(R) = F(R) - F_{\Pi}(R)$, где $F_{\Pi}(R)$ —линейная характеристика идеального омметра в виде прямой линии:

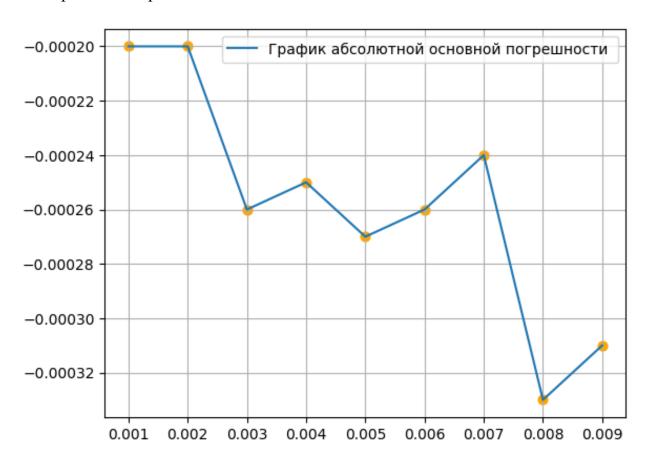


Рис. 2

Определение аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности.

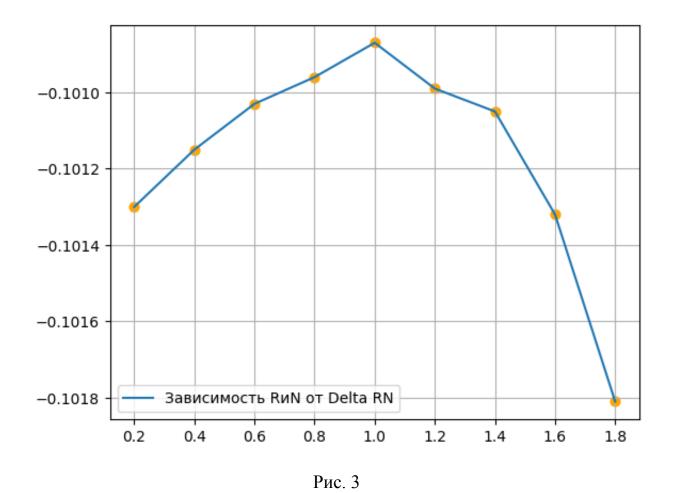
Расчищаем из полученных значений:

$$\Delta R_{\text{MN}} = R_{\text{\Pi N}} - 0.5 \cdot q - R_{\text{N}} = 0.2 - 0.5 \cdot 0.2 - 0.2013 = -0.1013;$$

Номер измерения	$R_{\Pi N}$, [кОм]	R_N , [кОм]	ΔR_{MN} , [кОм]
1	0.2	0.2013	-0.1013
2	0.4	0.40115	-0.10115
3	0.6	0.60103	-0.10103
4	0.8	0.80096	-0.10096
5	1	1.00087	-0.10087
6	1.2	1.20099	-0.10099
7	1.4	1.40105	-0.10105
8	1.6	1.60132	-0.10132
9	1.8	1.80181	-0.10181

Таблица 3

Построение графика зависимости $\Delta R_{\mathrm{H}N}$ от $R_{\mathrm{\Pi}N}$:



Измерение сопротивлений.

Номер	Номер	Диапазон измерени я	Значение кванта, [Ом]	Показания ЦИП $R_{\Pi_{,}}$ [кОм]	Абсолютная погрешность измерения ΔR , [кОм]	Относительная погрешность измерения, %	Результат измерения, $R_{\Pi} \pm \Delta R$, [кОм]	Квант
1	1	200 Ом	1	0.1162	0.0002424	0.209	0.1162 ± 0.0002	0.00001
2	1	2 кОм	10	0.115	0.00123	1.07	0.115 ± 0.0012	0.001
3	1	20 кОм	100	0.11	0.00122	1.109	0.11 ± 0.0012	0.001
4	1	200 кОм	1000	0.2	0.0104	5.2	0.2 ± 0.0104	0.01
5	1	2000 кОм	10000	0	0.00001	-	0.0 ± 0.0000	
6	1	20 мОм	100000	0	0.001	-	0.0 ± 0.0010	
7	2	200 Ом	1	-	-	-	-	
8	2	2 кОм	10	0.905	0.01181	1.305	0.905 ± 0.0118	
9	2	20 кОм	100	0.9	0.00181	0.201	0.9 ± 0.0018	
10	2	200 кОм	1000	1	0.003	0.3	1.0 ± 0.0030	
11	2	2000 кОм	10000	0	0.001	-	0.0 ± 0.0010	
12	2	20 мОм	100000	0	0.01	-	0.0 ± 0.0100	
13	3	200 Ом	1	-	-	-	-	
14	3	2 кОм	10	-	-	-	-	
15	3	20 кОм	100	8.17	0.01734	0.212	8.17 ± 0.0173	
16	3	200 кОм	1000	8.2	0.0264	0.322	8.2 ± 0.0264	
17	3	2000 кОм	10000	8	0.01601	0.2	8.0 ± 0.0160	
18	3	20 мОм	100000	0	0.001	-	0.0 ± 0.0010	

Таблица 4

Вывод: